

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2009年1月8日 (08.01.2009)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2009/005027 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2008/061823

(22) 国際出願日: 2008年6月30日 (30.06.2008)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2007-172871 2007年6月29日 (29.06.2007) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アルバック (ULVAC, INC.) [JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地 Kanagawa (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤井 佳詞 (FUJII, Yoshinori) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山

1220-14 株式会社アルバック富士裾野工場内 Shizuoka (JP). 望月 信明 (MOCHIZUKI, Nobuaki) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山1220-14 株式会社アルバック富士裾野工場内 Shizuoka (JP).

(74) 代理人: 浜野 孝雄, 外 (HAMANO, Takao et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋1丁目1番15号 物産ビル別館 Tokyo (JP).

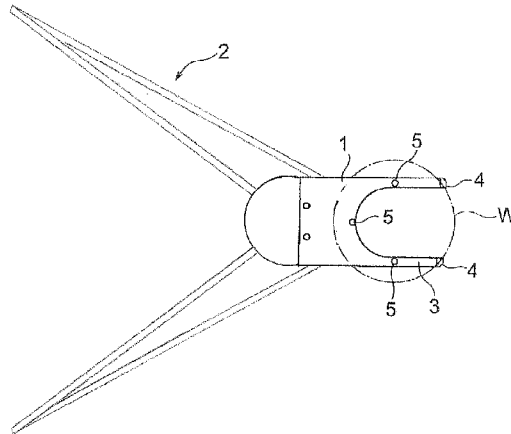
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE TRANSFER ROBOT AND VACUUM PROCESSING APPARATUS PROVIDED WITH THE SAME

(54) 発明の名称: 基板搬送ロボット及びそれを備えた真空処理装置

[図1]



(57) Abstract: Provided is a substrate transfer robot which can surely eliminate adhesion, shifting, dropping and the like of a substrate at the time of transferring the substrate. A vacuum processing apparatus provided with such substrate transfer robot is also provided. The substrate transfer robot is provided with a substrate receiving section for placing the substrate; a plurality of substrate slip preventing members, which are arranged on the upper surface of the substrate receiving section at intervals and are composed of an elastic material; and an extendable/retractable arm section whereupon the substrate receiving section is arranged at the leading end. On the upper end surface of the substrate slip preventing member, a protruding section is arranged. The vacuum processing apparatus is configured as a multi-chamber vacuum processing apparatus provided with the substrate transfer robot.

(57) 要約: 基板を搬送する際の基板の固着、ずれや落下等を確実に防止できる基板搬送ロボット及びそれを備えた真空処理装置を提供する。本発明による基板搬送ロボットは、基板を載置する基板受部と、基板受部の上面に夫々が間隔を置いて設けられた弾性体から成る複数個の基板滑り止め部材

[続葉有]



WO 2009/005027 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE,

SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

と、先端に基板受部が配設された伸縮自在なアーム部とを有し、基板滑り止め部材の上端面には、突起部が設けられている。また本発明による真空処理装置は前記の基板搬送ロボットを備えた多室型真空処理装置として構成される。